

計測器の校正は、「正確」「信頼」「安心」のJQAにお任せください。

ISO/IEC 17025に基づく校正機関として認定を受け、信頼性の高い校正サービスを提供します。

主な校正対象分野

●長さ・電気・放射線・温度・湿度・質量・硬さ・力・トルク・圧力・密度・体積・流速・流量・音響・加速度・濃度・時間等の計測器の校正

●各種出張校正

JQA

小間番号 東2ホール V-21

http://www.jqa.jp

一般財団法人 日本品質保証機構

お問合せ先

計量計測センター 事業推進課 TEL.03-3416-5554

〒157-8573 東京都世田谷区站1-21-25

SP部会第140回定例研究会・ISPP2015 プレゼンテーション

真空トピックス

定員 100名

日時 10/15 (水) 13:00~16:35

会場 会議棟 606会議室

主催 日本真空学会 / 日本真空工業会

顧問 日本真空学会・日本真空工業会会員…………… 3,000円

※スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会会員…………… 無料

一般……………5,000円 学 生……………1,000円 (予稿集代・消費税を含む)

■講演プログラム

※ご講演が希望となされた場合、プログラムの開演に要するまでに必ずお申し込みください

開会の挨拶 1300~1310

ISPP2015 実行委員長 / セントラル硝子 加藤 和広 氏

成膜技術を用いたデバイス開発と人センシングへの応用 1310~1355

東京医科歯科大学 三林 浩二 氏

半導体技術を活用したメディカルデバイス・システム(仮題) 1355~1440

ローム 丹羽 大介 氏

欧州のフレキシブルエレクトロニクス関連技術開発動向と日本 1500~1545

サーフデットトランスナショナル 鈴木 巧一 氏

生活支援ロボットの活用化の問題点 1545~1630

～生活支援ロボット安全検証センターの紹介を通じて～

産業技術総合研究所 大場 光太郎 氏

閉会の挨拶 1630~1635

日本真空学会 スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会 部会長 / 東海大学 沖村 邦雄 氏

真空入門講座

定員 各回 90名

日時 10/15 (水)~17 (金) 各10:00~12:00

会場 会議棟6階 609会議室 (主催) 日本真空工業会

顧問 一般……………3,000円 学 生……………1,000円 (資料代・消費税込み)

■講演内容

1. 真空の歴史 2. 真空の基礎 3. 真空計測 4. 真空ポンプ

5. 真空用材料 6. 真空部品 7. 真空装置の構成

担当講師

10/15 (水) 山口大学大学院 理工学研究科 物質工学専攻 准教授 栗奥 普輝 氏

10/16 (木) 日本電子(株) 品質保証室 製品順法グループ 次長 河合 英治 氏

10/17 (金) 神港機械(株) 滋賀守山工場 工場長付 浅見 博 氏

第15回 真空シンポジウム

定員 100名

日時 10/16 (木) 14:30~16:50

会場 東1ホール ワークショップ会場B

主催 日本真空学会 産学連携委員会 / 日本真空工業会

顧問 無料 ※予稿集・有料(2,000円 税別)

■講演プログラム

開会挨拶 14:30~14:35

日本真空学会 産学連携委員会 委員長 土岐 和之 氏

生活に欠かせない真空利用技術 14:35~15:15

真空テクノサポート・元日本真空工業会 専務理事 木ノ切 恭治 氏

真空管から真空ナノエレクトロニクスへ 15:15~15:55

京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 准教授 後藤 康仁 氏

ミニマルファブ構想 ~装置と部品の小型化の挑戦~ 16:05~16:45

産業技術総合研究所 ミニマルシステムグループ長・ミニマルファブ技術研究組合 研究開発部長 原 史朗 氏

閉会挨拶 16:45~16:50

日本真空学会 産学連携委員会 副委員長 富江 崇 氏

真空フォーラム2014

定員 200名

日時 10/17 (金) 13:00~17:00

会場 会議棟6階(605・606会議室)

主催 日本真空工業会 展示委員会 真空フォーラム・セミナー小委員会

顧問 日本真空学会・日本真空工業会会員…………… 3,000円

一般……………5,000円 学 生……………1,000円 (資料代・消費税込み)

■講演プログラム

■基調講演「MEMSの現在の市場と次世代のアプリケーション」

東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 下山 勲 氏

■一般講演

「RF-MEMSデバイスとその応用の現状と今後」(仮)

富士通研究所 ものづくり技術研究所 ハードウェアエンジニアリング研究部 主管研究員 中澤 文彦 氏

「MEMS光スキャナの特徴と産業への展開」

日本信号 ビジナリービジネスセンター MEMS事業推進部 (兼) EMS事業推進部 部長 川崎 栄嗣 氏

「バイオセンサー技術における健康センサーの進展」

タニタ 営業戦略本部 国際製品部 次長 伊藤 成史 氏

「MEMS製造技術の現状と今後の展望」

アルバック 技術開発部 要素技術開発部 新分野技術開発室長 上村 隆一郎 氏 (10月7日時点)



「VACUUM2014 真空展」は半導体やフラットパネル、太陽電池だけでなく、医療、食品などあらゆる分野で使用される真空技術に関する展示会となっております。会場では真空ポンプ、計測器、真空装置、部品・材料、表面加工技術など真空技術に関する機器・技術が展示される。36回目となる今回は「真空技術が生み出す未来」をテーマに、79社・団体、180小間が展示される。併催事業(主催者企画)として今回は、小回りのきく移動で注目を集めている「15日・17日 東京ビッグサイトで開催」。

「真空展」は半導体やフラットパネル、太陽電池だけでなく、医療、食品などあらゆる分野で使用される真空技術に関する展示会となっております。会場では真空ポンプ、計測器、真空装置、部品・材料、表面加工技術など真空技術に関する機器・技術が展示される。36回目となる今回は「真空技術が生み出す未来」をテーマに、79社・団体、180小間が展示される。併催事業(主催者企画)として今回は、小回りのきく移動で注目を集めている「15日・17日 東京ビッグサイトで開催」。

日本品質保証機構

日本品質保証機構(JQA)はマネジメントシステム・製品・環境などに関する認証、試験、検査を実施する第三者機関。全国15拠点で計測器の校正、ISO(国際標準化機構)などのマネジメントシステムやJIS(日本工業規格)マークの認証、電気製品や医療機器などの製品試験を提供している。1963年の校正業務開始以来の経験と豊富な実績に基づき、校正可能品目と範囲を順次拡大。日本の計量標準供給の一翼を担っている。また幅広い分野でJCSS(計量法校正事業者登録制度)や米国試験所認定協会のA2L Aにに基づく校正ができる。

VACUUM2014

真空展

「技術が生む未来」を紹介

15日から17日までの3日間、東京ビッグサイト東ホールで第36回「VACUUM2014 真空展」が開かれます。テーマは「真空技術が生み出す未来」。真空技術は、半導体、薄膜ディスプレイ(FPD)、太陽電池、電子分野だけでなく、食品、医療、分析機器や、昨今注目を集めている「真空技術が生み出す未来」。

日本真空工業会会長 酒井 純朗

「真空展」は、世界で唯一と言ってよい規模を誇る真空機器・真空装置の総合展示会となっております。これは、日本真空学会と日本真空工業会の緊密な協力、そして、空トピックス、真空開

「真空展」は、世界で唯一と言ってよい規模を誇る真空機器・真空装置の総合展示会となっております。これは、日本真空学会と日本真空工業会の緊密な協力、そして、空トピックス、真空開

最新の技術や機器・装置を披露

「真空展」は、15日(水)から17日(金)までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開かれる。同展は真空機器・装置に関する世界で唯一と言ってよい規模の専門展示会として知られ、最新の技術や機器が披露される。開場時間は10時から17時まで。入場料は1,000円(事前登録者または招待券持参者は無料)。

「真空展」は、15日(水)から17日(金)までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開かれる。同展は真空機器・装置に関する世界で唯一と言ってよい規模の専門展示会として知られ、最新の技術や機器が披露される。開場時間は10時から17時まで。入場料は1,000円(事前登録者または招待券持参者は無料)。

有力企業の製品・技術へ順不同

入江工研

入江工研は新たに開発した、廉価版大型矩形溶接ペロース(サイズは縦3000mm×横1600mm)を展示する。液晶製造装置のPMTチャンバー間の取り付け誤差吸収用(ストローク40mm)として廉価版構造を提案。剛性を保ちながら、約35%(当社比)のコストダウンに成功した。そのほか低露点(約80℃以下)、低酸素濃度(0.5ppm以下)を実現した「真空置換高純度グローブボックス」、低温 高温領域での結露・発熱問題に対応し真空断熱用としての温度性能を向上した「断熱用二重管フレキ(トランスフューチャー)」も展示する。

波無し軽量タイプ 廉価版 大型矩形ペロース

剛性を保ちながらコストダウンに成功 (当社比: 35% 減)

サイズ: (内径) 300 × 1600mm

ストローク 40mm

弊社ゲートバルブ (KOSLARZE, GARIVA) と合わせた機能設計も可能

真空展 弊社ブース No. V-020 (東2ホール)

■プロセスチャンバーとトランスファーチャンバー間の取付誤差吸収用大型矩形ペロースに廉価版登場

真空置換高純度グローブボックス

■有機半導体(塗布プロセス) 有機EL製造装置 二次電池製造設備に有用

グローブボックス内部の清浄度向上、ガス放出量削減 到達圧力の高真空化により 低露点: -80℃以下 低酸素濃度: 0.5ppm 以下を実現

『高砂工業』が手掛ける真空炉事業 TVHシリーズ 本格稼動!!

VACUUM2014 10月15日(水)~17日(金) 東京ビッグサイト 小間番号: V-010

TVD 真空洗浄機

装置概要

○使用目的ごとの操作を容易にし、製品形状・荷姿等により、最適条件を選択し運転可能。

急速洗浄 急速乾燥実現 サイクルの短縮

高品質洗浄 最適条件で運転可能 ワークにより工程選択可能

進化した操作性 操作が容易で見やすい 保守メンテナンスに 容易に対応

○大型凝縮器の開発により、製品を急速乾燥する。従来の乾燥時間の10分を1~2分へ大幅に短縮する。

TVC 真空浸炭炉

装置概要

○従来の真空浸炭炉より操作性、安全性を重視。省エネに配慮した新しい真空浸炭炉機軸支援ソフトを拡充したことで、最適条件を選択する事が可能となった。

○予防保全の計画通知システムを標準装備している。

高速浸炭処理 処理時間短縮 ランニングコスト削減

高品質浸炭 安定した品質確保 要求品質ごと 最適条件で運転

進化した操作性 メンテナンス性向上 予防保全ソフト 標準装備

○最大の特長は、浸炭処理時間。昇温から油焼入れ完了までのサイクルタイムを最短とし、従来の真空浸炭炉と比べ、30~45分の削減が可能となった。

○経時変化がほとんどなく長期にわたり安定した条件、処理時間を確保できる炉構造となった。

TVHシリーズ 真空炉の構成と特長

高品質装置

安定した品質が得られる製品の要求品質により機種選定・最適条件で運転

低コスト仕様

装置のインシャルコストを低く抑え、かつ処理時間の短縮によりランニングコスト削減

進化した操作性

操作が容易で見やすい運転画面、予防保全を定期報知するメンテナンス対応

地球環境にやさしい

徹底した省エネ運転にて従来の真空炉のエネルギー、処理時間の削減